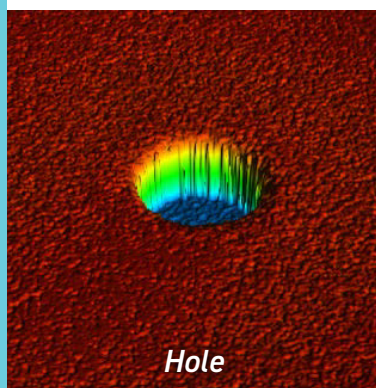
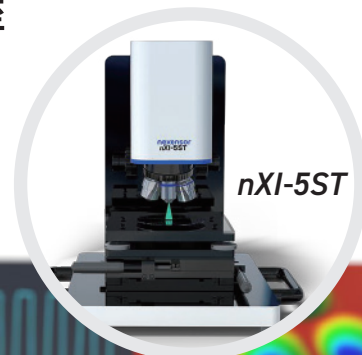


# nXI-5SC/nXI-5ST

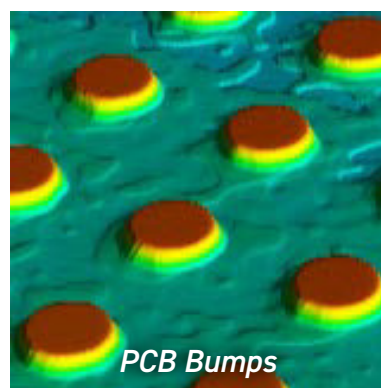
# nexensor

## 顕微鏡型 3D 白色干渉変位計

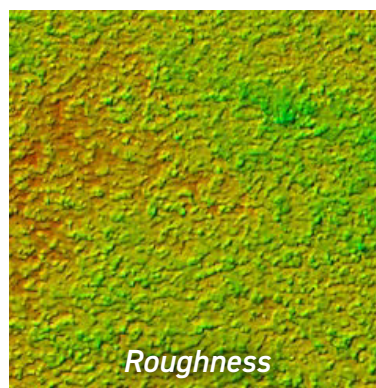
高速にサブマイクロスケールの構造を把握



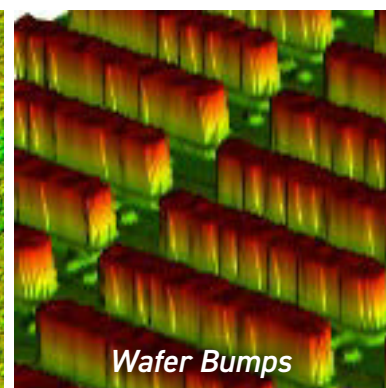
Hole



PCB Bumps



Roughness

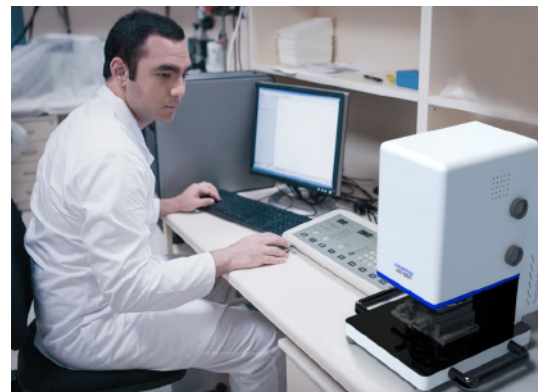


Wafer Bumps

- 1秒以下の測定時間
- 1回のスキャンで表面と膜の下の構造を測定
- 段差・幅・角度・体積・粗さ・平坦度などの測定
- 顕微鏡タイプ、タレットタイプ

Nexensor 社の nXI-5SC/nXI-5ST はサブマイクロスケールの領域の表面構造を精度よく高速に測定する 3D 白色干渉変位計です。

動作に必要な機器が組み込まれたスタンドアロンのシステムで研究・開発・品質管理に最適です。1秒以下の測定時間で段差・幅・角度・粗さ・平坦度など様々な測定が可能。1 $\mu$ m薄膜の分離が可能で、1度のスキャンで表面と膜の下の構造を測定できます。



## 仕様

※お客様サンプルのデモ測定をご希望の場合はお気軽にご相談ください。

システム	測定原理	3D 白色干渉・変位計測技術			
	スキャンタイプ	エリアスキャン			
	スキャンレンジ	200μm			
	カメラ	解像度：1920 × 1200 ピクセルサイズ：3.45μm			
	垂直分解能	5 nm			
	繰返精度	0.2% (Standard/Step Height 10μm)			
	スキャン時間	< 1 s			
	サイズ	363 × 360 × 440mm (x10レンズの場合)			
	X,Yストローク	70 × 50mm (マニュアル)			
	Zストローク	30mm (マニュアル)			
	ステージサイズ	90 × 90mm			
	内容物	本体, コントローラー, PC (言語選択：英語、韓国語)			
	三次元測定及び解析ソフトウェア NX-SCANソフトウェア				
光学系	レンズ倍率	10x (nXI-5SC/nXI5-ST)	20x (nXI-5SC/nXI5-ST)	5x (nXI-5ST)	50x (nXI-5ST)
	計測エリア (mm)	0.662 × 0.414	0.331 × 0.207	1.324 × 0.828	0.132 × 0.082
	WD	7.4mm	4.7mm	10.3mm	3.4mm
	ピクセル分解能	0.345μm	0.172μm	0.69μm	0.069μm
	NA	0.3	0.4	0.13	
	オプション	除振台	400 × 500 × 100mm		

## nXScan / nXView

### 付属ソフトウェア

製品付属の nXScan・nXView はそれぞれ計測用・解析用の専用ソフトウェアです。

計測面のライブビュー表示や計測設定の変更が簡単に行え、特定箇所の段差・幅・角度・体積・粗さ・平坦度などが直感的な操作で確認できます。

